

シリコン系アモルファス半導体における水素やフッ素の入り方と欠陥

メタデータ	言語: jpn 出版者: 公開日: 2023-03-13 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: Shimizu, Tatsuo メールアドレス: 所属:
URL	https://doi.org/10.24517/00068228

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 International License.



シリコン系アモルファス半導体における水素やフッ素の入り方と欠陥

Research Project

All



Project/Area Number

59540176

Research Category

Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)

Allocation Type

Single-year Grants

Research Field

固体物性

Research Institution

Kanazawa University

Principal Investigator

清水 立生 金沢大学, 工学部, 教授

Project Period (FY)

1984

Project Status

Completed (Fiscal Year 1984)

Budget Amount *help

¥1,900,000 (Direct Cost: ¥1,900,000)

Fiscal Year 1984: ¥1,900,000 (Direct Cost: ¥1,900,000)

URL: <https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-59540176/>

Published: 1987-03-30 Modified: 2016-04-21